

精密イオンポリッシングシステム

メーカー:GATAN
型番:Model 691 PIPS

【仕様】

- ・イオンガン:ペニング型イオンガン 2機
- ・イオンビームエネルギー:1.5keV~6.0keV
- ・ミリング角度:±10° (個別調整可能)
- ・試料回転:1~6rpm
- ・サンプルサイズ:φ3mm、厚さ100μm
- ・CCDカメラによるミリング中の観察が可能



本装置の概要・用途

本装置は主に塊状試料のTEM観察試料作製に用いられる。予め直径3mm、厚さ100μmに調整した試料にアルゴンイオンビームを照射して試料中心に貫通孔を開ける。
またアルゴンイオンによるエッチングを利用しSEM観察用の試料作製も出来る。

使用例

透過型電子顕微鏡および走査型電子顕微鏡の「観察・測定例」を参照。